
2023年日本結晶成長学会特別講演会 開催のご案内

『結晶評価研究の最前線』

あらゆる結晶材料において、構成元素の原子配置、不純物元素・点欠陥・その他結晶欠陥の分布や性質、および、電子・電気・光学的特性を明らかにすることは、結晶成長技術の発展だけでなく結晶成長メカニズムの基礎的理解においても極めて重要です。

本講演会では、結晶評価研究の第一線でご活躍されている先生方を講師としてお招きし、様々な手法を用いた最先端の結晶評価技術の開発例や結晶評価研究例を紹介していただきます。

各手法により、どのような情報が得られるのか、また、それらが結晶成長研究にどのように活用できるのかを考え議論する場となれば幸いです。

- 【日 時】 2023年6月23日(金) 13時00分～17時10分(予定)
【会 場】 大阪電気通信大学寝屋川キャンパスコンベンションホール
A号館(OECUイノベーションスクエア)1階(大阪府寝屋川市初町18-8)
※ オンラインによる配信はありません。
【主 催】 日本結晶成長学会
【協 賛】 大阪電気通信大学エレクトロニクス基礎研究所

【プログラム】

- 13:00-13:05 開会挨拶
13:05-13:50 「蛍光X線・中性子ホログラフィーによる単結晶中の特異欠陥構造の評価」
林 好一(名古屋工業大学)
13:50-14:35 「高分解能走査透過電子顕微鏡STEM法および分光法による原子レベルでの
結晶構造解析と組成・化学状態分析」
渡辺 万三志(リーハイ大学)
14:35-14:50 (休憩)
14:50-15:35 「陽電子を用いたワイドギャップ半導体結晶中の点欠陥評価」
上殿 明良(筑波大学)・石橋 章司(産業技術総合研究所)
15:35-16:20 「テラヘルツ時間領域エリブソメトリによる半導体の電気的特性評価」
中嶋 誠・Verdad Agulto・加藤 康作・岩本 敏志(大阪大学レーザー科学研究所)
16:20-17:05 「第一原理計算やマテリアルズ・インフォマティクスを活用した材料研究」
森分 博紀(ファインセラミックスセンター)
17:05-17:10 閉会挨拶

参加費：正会員 5,000円、一般(非会員) 6,000円、学生会員 2,000円、学生(非会員) 3,000円
(賛助会員企業所属の方は、正会員扱い)

懇親会：会場未定
参加費 5,000円

詳細：日本結晶成長学会 HP に掲載 (<https://www.jacg.jp/jp/event/lecturesp.html>)

申込：学会ホームページよりお申し込みください。

問合せ：日本結晶成長学会事務局 増田 和歌子 (Tel: 070-5047-3339, E-mail: jimukyoku[at]jacg.jp)